ASTRO-H 衛星搭載X線CCDカメラ開発用試験系の整備

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 高エネルギー天文学研究系 東京工業大学大学院 理工学研究科 基礎物理学専攻 修士課程1年 岩井 將親

1 はじめに

現在、2014年に打ち上げ予定である次期 X 線天文衛星 ASTRO-H に搭載する X 線 CCD カメ ラ (SXI)の開発を進めている。そのため、搭載品と同等だが小型の mini-CCD と駆動読み出し回 路の試作モデルを用いた試験系の整備を行っている。本発表では、ASTRO-H 衛星・X 線 CCD カ メラ (SXI)の概要とともに、CCD カメラ開発用試験系の整備について私が担当している箇所を中 心に述べる。

2 ASTRO-H 衛星とX線CCD カメラ (SXI)

2.1 ASTRO-H 衛星

ASTRO-H 衛星は、日本で 6 番目の次期 X 線天文衛星である。ASTRO-H 衛星は、軟 X 線撮像 検出器 (X 線 CCD カメラ:SXI)、軟 X 線分光検出器 (SXS)、硬 X 線撮像検出器 (HXI)、軟 線検 出器 (SGD)の4つの観測機器を搭載し、0.2-600keV に及ぶ広帯域の撮像・分光観測を行うことが 可能である。

2.2 X線CCDカメラ (SXI)

軟 X 線望遠鏡 (SXT-I) から 5.6m 離れた焦点面に配置され、SXT-I とともに軟 X 線撮像システムを構成する。低エネルギー側の検出効率を高くするため、CCD 素子には新たに開発した P-ch 裏面照射型 CCD を採用し、0.3-12keV の撮像 / 分光を行う。エネルギー分解能は 5.9keV の FWMHで 150eV 以下を目指している。また、CCD 素子の放射線劣化抑制の観点から機械式冷凍機を導入し、CCD 素子を-120 に冷却し動作させる。

3 SXI-EM 地上用試験系セットアップ

SXI-EM(engineering model)CCD カメラの性能評価のため、軌道上と同じく mini-CCD を-120 まで冷却し、SXI-EM を用いて end-to-end で mini-CCD からデータ取得を行うシステム、SXI-EM 地上用試験系セットアップを実験室内で構築する。SXI-EM 地上用試験系セットアップは、大き く CCD 読み出し回路と冷却系で構成される。CCD 読み出し回路は、3 つの基板から構成される。 Sequencer からのタイミングをもとに駆動信号を CCD へ供給するドライバーボード、CCD から の出力の A/D 変換処理を行う ASIC 基板と FPGA 基板から成るビデオボード、それらに必要なク ロックパターンの供給と外部へのインターフェースを提供するインターフェースボード (MIO) で ある。冷却系は、CCD を設置する真空槽、機械式冷凍機、ヒーターで構成される。私は、冷却系 を担当しており、詳しくは以下で述べる。



図 1: SXI-EM 地上用試験系セットアップの概略図

4 冷却系の整備

SXIでは、CCD を-120 程度で動作させるので、本試験系でも mini-CCD を-120 まで冷却す る必要がある。そこで、CCD は真空槽に設置し、機械式冷凍機とヒーターで温度制御が可能な構 成にしている。CCD を真空槽に設置した理由は、大気中で CCD を冷却すると表面に霜が付着し てしまうためである。機械式冷凍機の最低到達温度は-213 であり、-213 において mini-CCD は電荷転送が十分にできない。これは、電荷転送に電子の熱拡散を利用しているためである。その ため、熱拡散を利用した電荷転送と放射線劣化の抑制の観点から CCD 動作温度は-120 に設定さ れた。機械式冷凍機は一定パワーで動作、細かい温度制御はヒーターで行い、CCD を-120 に冷 却する。

4.1 真空槽内への基板の配置

mini-CCD 周りのアナログ信号は、ノイズの影響を受けやすいので、アナログ信号に関わる基板 (Driver-board、Video-board の ASIC 基板)は、mini-CCD とともに真空槽内にマウントするこ とにする。それ以外の基板は、真空槽外に配置する。

4.2 冷凍機単体試験と熱見積もり

真空槽内の冷却部(冷凍機の cold-head 部分)と mini-CCD 設置場所の位置関係より、冷却部 と mini-CCD の間には温度勾配が生じる。冷却部の温度に対し、mini-CCD 部分は 10-20 ほど 温度が高くなると推定される。そのため、mini-CCD を-120 程度に冷却するため、cold-head 部 は-130 程度に冷却する必要がある。cold-head 部を-130 程度に冷却するため、ヒーターにより cold-head 部に加える熱量の概算を知る必要がある。そのために、冷凍機単体試験を行い、白金側 温抵抗体により冷凍機の cold-head 部の温度推移を調べた。図2がその結果である。



図 2: 冷凍機単体試験 cold-head 部の温度推移。縦軸は温度 []、横軸は時間 [min]。t=0 で冷凍機 を ON にし、t=50 で冷凍機 OFF とした。 ~ 20min で ~ 240 低下し、cold-head 温度は-213 ま で達した。

冷凍機単体試験より、-130 における温度冷却率は~0.2 /s であることがわかる。ここで、-130 におけるアルミニウムの比熱は、アルミニウムの比熱 C[J/g/K] の近似式(適用範囲:-227~753)

$$C = 4.186aT^{b}e^{cT}e^{d/T} (a = 6.27, b = -0.547, c = 0.000925, d = -157)$$
(1)

より、-130 、つまり T=~140K において~0.653[J/g/K] となる。冷凍機の cold-head 部の体 積は、冷凍機外観寸法図より~ $19cm^3$ であり、アルミニウムの密度 [g/cm³] は、温度による体積変 化率は無視できるほど小さいので 2.7g/cm³ である。以上の結果を用いて、-130 における冷凍機 の冷却能力が~ 8 Wであることが推定される。

4.3 温度制御系

熱見積もりの概算より、30 のテープヒーター1枚を用いたとき、テープヒーターに~15Vの 電圧を印加すれば cold-head 部に~8Wの熱量を与えられる。温調器の出力電圧は最大 10V なの で、温調器とヒーターの間に直流安定化電源をはさみ、出力電力を最大 18V まで増幅することに した。温度制御は、温調器の PID 制御を用いて、設定値と測定値の偏差から温調器自身がヒーター 側に出力する操作量を加減することにより行う。mini-CCD(付近)の温度測定は、4 線式白金測 温抵抗計を用いる。下に温度制御系統図と冷却系セットアップの概略図を載せる。



図 3: 温度制御系統図



図 4: 冷却系セットアップの概略図

5 今後

実際に冷却系セットアップを組み上げ、mini-CCD を用いない冷却試験、mini-CCD を用いた冷 却試験を行う。その後、冷却系セットアップを含めた SXI-EM 地上用試験系セットアップを用い て mini-CCD の性能評価試験を行っていく。